

高真空蒸着装置 ED-1700



高真空蒸着装置ED-1700は電子銃(JEOL製 JEBG-303UA)によるマルチコートを目的にした装置でありルツボ4点(予備1点)をトリプルソースコントローラにて成膜することが出来ます。また基板急冷機構及び膜厚センサーを4箇所設けてあります。排気系はオイルフリーを目的とし、ドライポンプ+クライオポンプ、差動排気用ターボ分子ポンプの組合せにより短時間かつクリーンな排気が可能です。まさに新時代に必要な万能装置といえるでしょう。

高真空蒸着装置 ED-1700 仕様

- 到達圧力 ×10⁻⁶Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ800mm×1000mmH SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃電源:JST-16F(JEOL製)
電子銃ルツボ:JEBG-303UA(JEOL製)
ルツボ個数:4個
- 放電機構 高周波電源:RF-12020(JEOL製)
高周波出力:0~1.5kW
発信周波数:13.56MHz±0.005%
自動整合器:EH-MN03A(JEOL製)
- 基板形状 8インチ 4枚or6インチ 7枚
- 基板回転 ドーム形状:φ550mm×100mmH×2t(材質:Al)
モーター直接駆動方式 0~25rpm
- 基板加熱 ハロゲンランプ1.5kW×2式
常温~400°C迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計(4ch)
- 真空排気系 ドライポンプ:1660L/min[50Hz]
ターボ分子ポンプ:810L/sec
クライオポンプ:5000L/sec
- 圧力制御 バルブコントローラ:651CD2S1NJ(MKS製)+スロットルバルブ:653B-2-50J-2(MKS製)
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計/バラトロン真空計
- ガス機構 マスフローコントローラ×2式
- ユーティリティ電気:AC200V三相47kVA
冷却水:40L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25°C以下循環
計装エア:0.5MPa以上
設置寸法:2600mmW×3000mmD×2200mmH